

MPV-MS Series for R&D

Dead area can be minimised by high precision patterning with narrow and little peeling lines.

狭幅で膜剥がれの少ない高精度のパターニングがデッドエリアの縮減を実現。

The world standard model of FPD glass cutting machine has now be modified for PV patterning.

The best P2/P3 patternings on any CIGS panel can be made by patterning tools which MDI has originally been developing and manufacturing.

ガラス分断装置のロングセラーを太陽電池パターニング用途に改良。

MDI が独自に開発・製造するパターニングツールがあらゆる CIGS 基板に適切な P2/P3 パターニングを提供。



The outside appearance and specifications are subject to change without notice.

外観、仕様は予告なしに変更になることがあります。

Mechanical Patterning Machine for CIGS

CIGS 薄膜太陽電池用メカニカルパターニング装置 MPV-MS シリーズ

MPV-MS Series for R&D

Specifications

Glass Thickness	対応基板厚み	1.0mm-4.0mm	
Mechanical Patterning Width	パターニング幅	30~100μm ※1	
Alignment System	画像認識	2cameras with auto alignment	
Operating System	動作制御	PCWindows®OS	
Utility	ユーティリティ	Power	AC200 3-phase
		CDA	0.5Mpa 30L/min
		Vacuum	-60 k Pa 40L/min

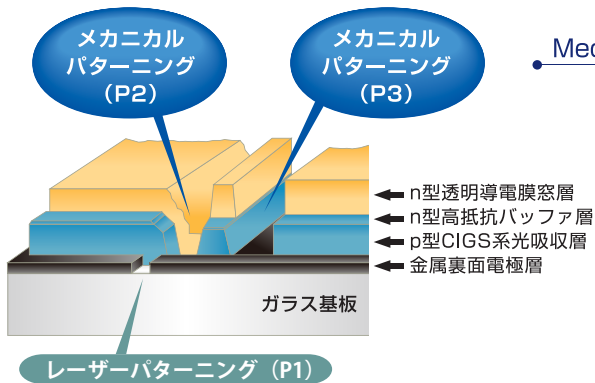
MODEL		MPV300-MS	MPV500-MS
Glass Size ※2	対応基板サイズ ※2	300mm×300mmMAX	500mm×500mmMAX
Dimensions(W×D×H)	装置寸法	900×1,415×1,430mm	1,180×1,650×1,972mm
Weight	重量	approx. 800kg	approx. 950kg
Speed	速度	500mm/sec MAX	

※1 Subject to confirmation by actual panels.
 ※2 Other size can be applied. Please contact us for details.

※1 実基板の状態により異なる場合もあります。
 ※2 上記以外のサイズに対しても対応いたしますので、詳細は当社までお尋ねください。

Mechanical Patering

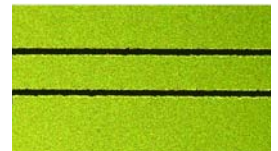
集積構造のCIGS系薄膜太陽電池サーキット



P3 パターニング加工状態の比較

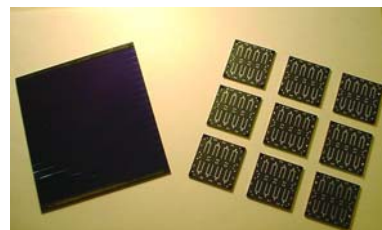


Current Process
(従来工法)



New MDI Process
(当社新プロセス)

基板分断例 (Option)



Contact

www.mitsuboshidiamond.com

※Trademarks and registered trademarks used herein are the property of their respective owners.
 ※本カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

※The specs are subject to change without prior notice.
 ※記載された仕様は予告なく変更することがあります。

MDI MITSUBOSHI DIAMOND INDUSTRIAL CO., LTD.